

プラズマ堆積サービス

紹介

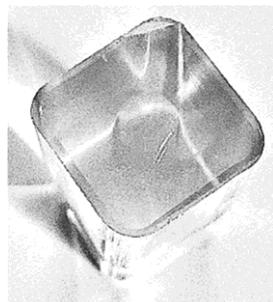
プラズマ外付堆積プロセスは、高フッ素添加シリカ層の成膜が必要な特殊光ファイバを製造するための重要な技術です。このような光ファイバは、生物医学、航空宇宙、産業および防衛用途で使用されています。プラズマ強化製品は、商用機器サプライヤーや必要な技術知識が不足しているため、世界市場で広く入手できません。



PLASIL OPDプラズマ技術

Plasilは、独自の外付けプラズマ堆積技術の開発に成功し、小規模製造に適したOPDプラズマ堆積システムを設計しました。このシステムは、スロベニアのログテツ市にあるPlasilの開発ラボに設置されています。また、継続的な機器やプロセス開発に使用されます。PlasilのOPD蒸着能力の仕様は、以下の通りです。

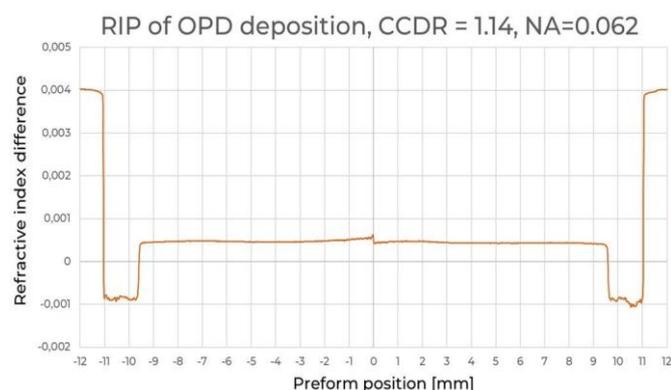
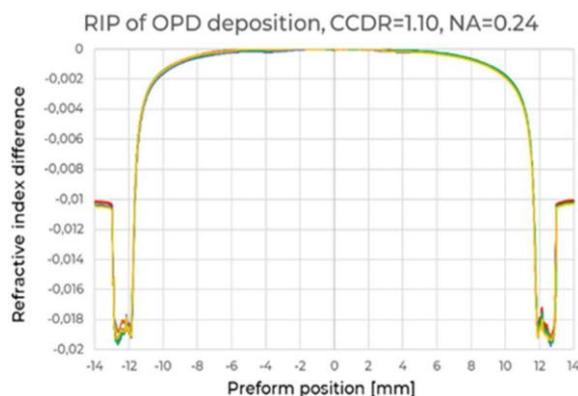
パラメーター	価値
コーツサンプルの長さ	最大 450 mm
石英サンプル開始外径	10 – 40mm
石英試料端外径	外径変化10%、最大44mm
堆積したFドープ層のNA	0 – 0.25 (純シリカに対して)
コーツサンプル形状	ロッドまたはチューブ;円形、正方形、または八角形の外形



PLASILプラズマ堆積サービス

設置されたOPDシステムにより、Plasilは、学術、研究、または産業分野の関心のある顧客に、少量の生産バッチでカスタムの外部シリカ層堆積サービスを提供することができます。自社の光ファイバプリフォームやその他のシリカ製品の外面に非ドープまたはFドープシリカ層を適用することに関心のあるお客様は、注文と仕様に関してPlasilの営業担当者にお問い合わせください。OPDシステムでは、酸素プラズマフレームによる表面洗浄が可能で、シリカ製品は堆積前にH₂ / O₂バーナーフレームで表面研磨できます。

PlasilのOPDマシンで作成された屈折率プロファイルの異なる2つの例を以下に示します。



+386 31 873 415
info@plasil.si
www.plasil.si

プラシルプラズマテクノロジーズ株式会社
登録番号: 8740569000 | 付加価値税番号: SI93863365
IBAN: SI56 0311 2100 0662 376 | SWIFT:SKBASIX
リュブリャナ地方裁判所に登記



詳細お問合せ先:

合同会社ヒロ・デザイン・ファクトリー

tel:070-3837-9360 Web: <https://www.hiro-df.com> e-mail:info@hiro-df.com